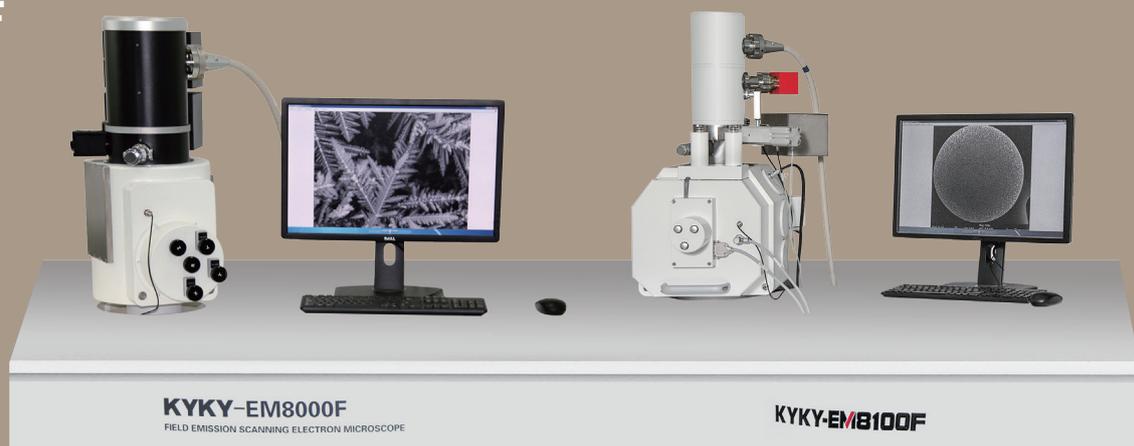


# 场发射枪扫描电子显微镜

Field Emission Scanning Electron Microscope

8000F/8100F



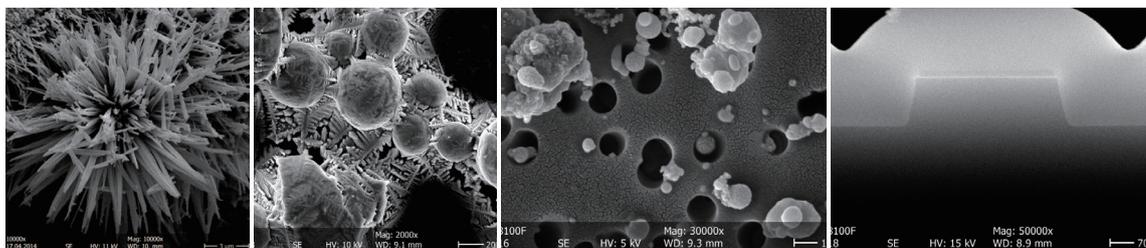
## 性能指标

- 分辨率: 1.0 nm@30kV, 3.0 nm@1kV
- 加速电压: 0—30 kV
- 放大倍数: 15×—80000×

## 主要应用

材料科学、生命科学、先进制造、半导体制作工艺研究、环境保护、航空航天、先进能源、现代农业等

## 代表性应用成果



碳纳米管研究

病毒检测

PM<sub>2.5</sub> 污染物研究

半导体芯片工艺研究

主要用户单位	北京大学、中国科学院大学、上海交通大学等
研制单位	北京中科科仪股份有限公司
联系方式	孙占峰 010-82548109, 13520785335 zhfsun@kyky.com.cn